

Semiconductor

ALD 7 Diaphragm Valve



Key Features



High Flow Capacity

최대 0.7 유량 계수(Cv)를 제공하며 정확하고 반복적인 투여량을 자랑합니다.



Precise Actuation

개선된 액추에이터(Actuator) 사용으로 <7ms의 빠른 응답 속도를 보여줍니다.



Thermal Immersibility

밸브 바디 온도가 최대 200°C까지 견딜 수 있는 스펙을 제공합니다.

Specification

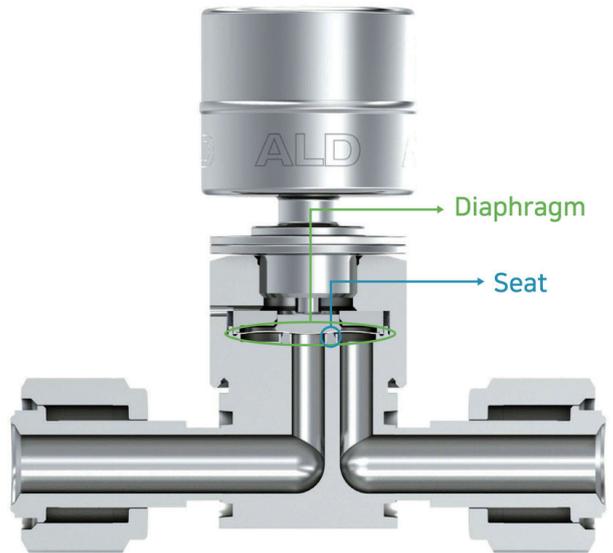
		ALD 7
1	Flow Coefficient	0.7
2	Working Pressure	Vacuum to 145 psig
3	Burst Pressure	> 3,200 psig

Materials

4	Body	316L VIM-VAR
5	Seat	PFA
6	Diaphragm	Cobalt-based Superalloy

End-Connections

7	VCR Fittings
8	Tube Butt Weld
9	1.5 in Modular Surface-mount high flow C-seal

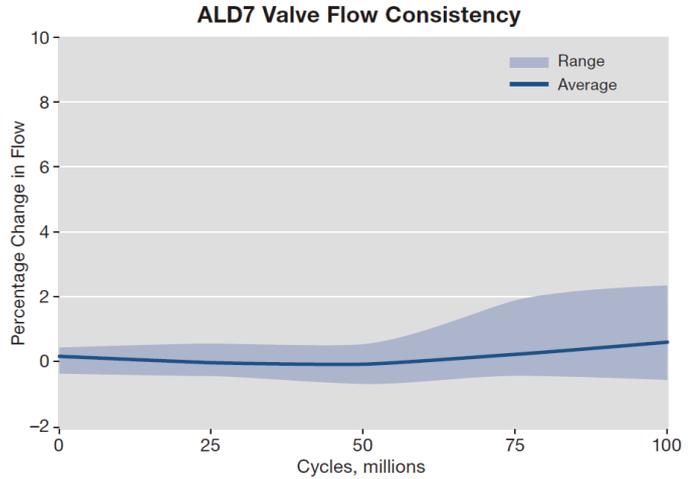
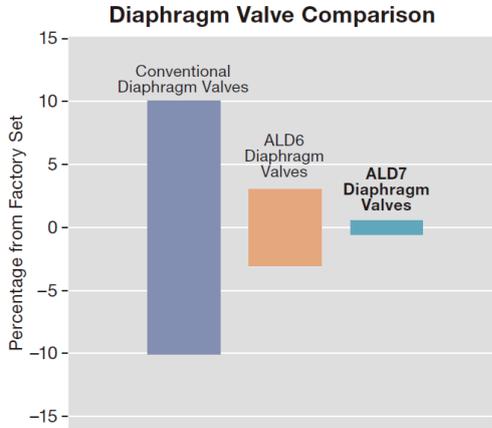


스웨즈락 ALD7 밸브는 생산성 향상을 고민하는 반도체 제조사와 공급업체에 간단하고 효과적인 솔루션을 제공합니다.

Technical Report

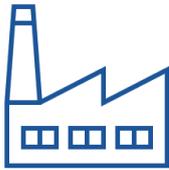
For Better Performance

- 스웨즈락의 ALD7 시리즈는 총 32개의 밸브를 SEMI F32 기준에 따라 20°C의 실온에서 1억 회 작동 사이클 시험을 실시하였습니다. 시험 결과, 5천만회 사이클까지 유량변화는 약 1% 이내로 유지되어 안정적인 성능을 입증하였습니다.



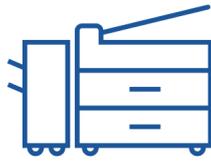
		ALD 7
Consistent Flow	Flow variation Valve to Valve	±1%
	Flow variation over cycle life	2%
Consistent Speed	Actuation Speed	<5ms
	Response Time	<7ms
Consistent Temp.	Max. Body Temp.	200 °C
	Max. Actuator Temp.	150 °C

Applications



Semiconductor FAB

초정밀 공정이 요구되는 반도체 생산라인에서 뛰어난 유량 일관성과 빠른 응답 속도를 통해 공정의 신뢰성과 생산성을 향상시킵니다.



Deposition Equipment

정밀 증착 공정에서는 균일한 막 형성과 안정적인 유체 제어가 핵심입니다.



Gas & Chemical

가스 및 화학약품 공급 공정에는 고온 및 부식 환경에서도 안정적인 유체 제어가 요구됩니다.

Contact Us

- Email: SwagelokKorea@swagelok.co.kr
- Phone: 02) 1833-2230